

## SEM・表面分析・前処理セミナー@福岡への参加

報告者	松井 春美	報告日時	令和5年12月26日(火)
実施場所	TKP ガーデンシティ PREMIUM 天神スカイホール	実施日時	令和5年11月29日(水)
参加職員数	1名		

### ・報告

福岡で開催された日本電子株式会社主催のユーザーズミーティングに参加しました。午前中には、新型の走査電子顕微鏡(SEM)の紹介、SEMで粒子解析を行う際の試料固定方法のコツ、電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)での定量分析におけるデータ処理手法について講演があり、本校で所有している装置との関連性が強いことから、有意義な情報を多く得ることができました。午後からは、SEM用自動測定ソフトにおける制御方法、ウィンドウレスエネルギー分散型X線分光器(EDS)の適用事例、オージェ電子分光装置(AES)を利用したエネルギー損失分光法(REELS)の測定事例、新型集束イオンビーム装置(FIB)の紹介、透過電子顕微鏡(TEM)の基礎について講演があり、現時点では直接管理する対象機器ではないものの、今後の装置新規導入並びに更新の際に参考となる知見を得ることができました。

### ・詳細

講演の合間の休憩時間には、別室でポスター展示があり、装置担当者に直接話を伺う機会がありました。装置更新の際に参考となる、カタログには載っていない部分の情報を得ることができ、大きな収穫となりました。また特殊試料ホルダの実物を手に取ることができ、今後購入を検討したいと思ったところです。このような情報は現地参加でなければ得られないものですので、今後も参加する機会をいただきたいと思います。